

# エリオニクスは創造企業として、 科学技術の進歩に貢献します。

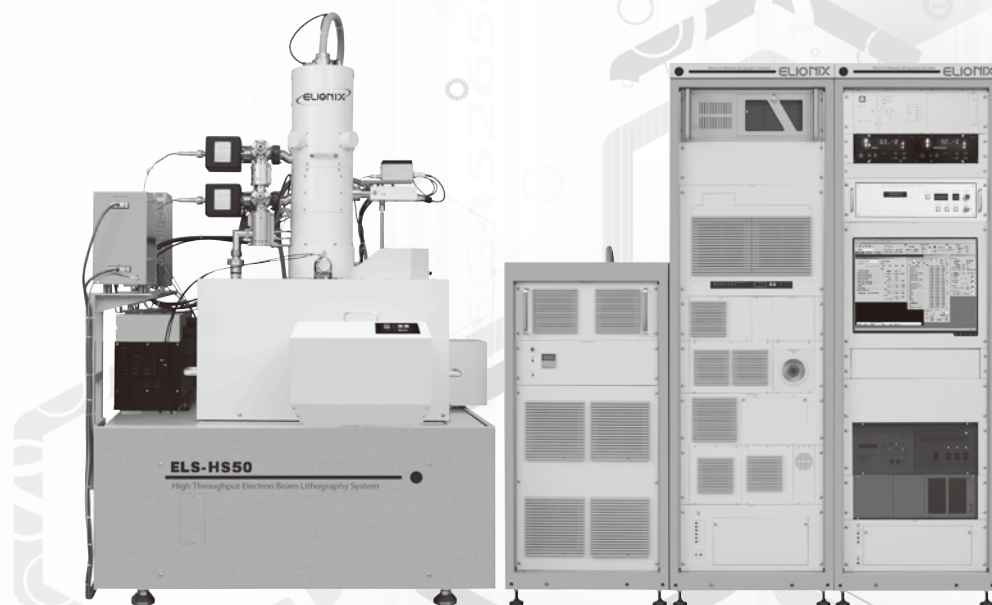
高スループット電子ビーム描画装置

## ELS-HS50

Electron Beam Lithography System

**The Revolution of EBL**

ポイントビームEB描画装置に革命をもたらす。大電流、広領域低歪描画が実現する、異次元の高スループット。研究用/生産用と多目的に使用可能です。既存装置の最大20倍のビーム電流値で描画することにより、描画時間を大幅に短縮しつつ、ビーム電流100nAでビーム径10nmを実現しました。1,500 $\mu$ m  $\times$  1,500 $\mu$ m (@50kV)という広いフィールドにおいても、中央部と外縁部の寸法誤差を限りなく少なくし、デバイス製造分野のニーズに応えます。



<https://www.elionix.co.jp/>

**株式会社 エリオニクス**

[本社・ショールーム] 〒192-0063 東京都八王子市元横山町3-7-6

[ナノテクシステムセンター] 〒192-0012 東京都八王子市左入町279

[西日本営業所] 〒563-0025 大阪府池田市城南1-9-22 AXIS 池田グリーンプラザ1 2階

TEL.042-626-0611 FAX.042-626-6136

TEL.042-692-0610 FAX.042-692-0690

TEL.072-754-6999 FAX.072-754-6990

